

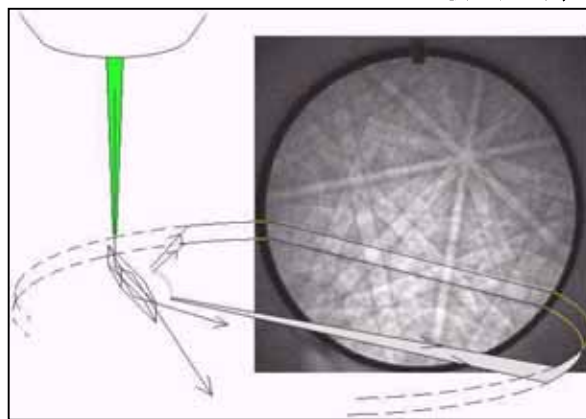
# E B S P

## Electron Back Scatter Diffraction Pattern (後方散乱電子線回折解析装置)



装置  
OXFORD INST. INCA Crystal 300

【原理】 高傾斜した試料に電子線を照射し、後方散乱して形成されるチャネリングパターンをスクリーンに取り込み、その照射点の結晶方位測定を行う。



- 【特徴】 SEMオーダーでの微細領域の結晶方位解析
- 【適応分野】 局所における方位マップ、結晶粒径分布解析、極点図および逆極点図解析
- 【応用例】 2相ステンレス鋼 断面のEBSP解析

